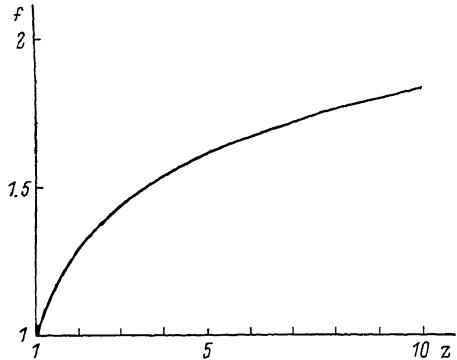


Из сказанного выше следует, что в качестве нижней оценки времени жизни относительно ухода на нити можно принять выражение

$$\tau = \frac{2}{\pi a \bar{v}_h \varphi f (\bar{v}_e / \bar{v}_h)} . \quad (10)$$

Для GaAs  $\bar{v}_e / \bar{v}_h = \sqrt{m_h/m_e} \approx 2.5$ ,  $f(2.5) \approx 1.4$ , т. е.  $\tau \approx 3 \cdot 10^{-12} (300 \text{ K}/T)^{1/2} \times$   
 $\times (10^{-7} \text{ см}/a) (10^{11} \text{ см}^2/\varphi) \text{ с.}$

Заметим, что ННЗ рассматривались нами как классические частицы. Учет их квантовых свойств в рамках двумерного аналога нерезонансной модели ядер-



Вид функциональной зависимости  $f(z)$ , используемой в выражениях (9), (10).

уменьшение не слишком существенно. По порядку величины и ходу зависимости от  $T$  и  $\varphi$  полученное выражение согласуется с экспериментом [2]. Расчетные значения времени жизни несколько меньше экспериментальных, что, по-видимому, связано прежде всего с наличием отражения носителей от нитей.

Авторы благодарны В. И. Перелью за исключительно полезные обсуждения, а также Е. Л. Портному за предоставление результатов работы [2] до ее публикации.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Алфёров Ж. И., Журавлев А. Б., Портной Е. Л., Стельмах Н. М. — Письма ЖТФ, 1985, т. 12, в. 18, с. 1093—1098.
- [2] Журавлев А. Б., Марущак В. А., Портной Е. Л., Стельмах Н. М., Титков А. М. — ФТП, 1988, т. 22, в. 2, с. 352—354.
- [3] Каган Ю. М., Перель В. И. — УФН, 1963, т. 81, в. 9, с. 409—452.
- [4] Дмитриев С. Г. — ФТП, 1987, т. 21, в. 8, с. 1444—1447.
- [5] Блатт Дж., Вайскопф В. Теоретическая ядерная физика. М., 1954. 658 с.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Получено 26.02.1988  
Принято к печати 25.03.1988

ФТП, том 22, вып. 8, 1988

## ИЗМЕНЕНИЕ ГРАДИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЛИТИЯ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ МЕТОДОМ ДРЕЙФА ИОНОВ

Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б.

Динамика установления концентрации при дрейфе ионов лития в электрическом поле теоретически рассмотрена в [1]. В настоящей работе изучено изменение градиента концентрации лития в процессе компенсации. Показано, что в окрестности  $p-n$ -перехода должно наблюдаться экспоненциальное убы-

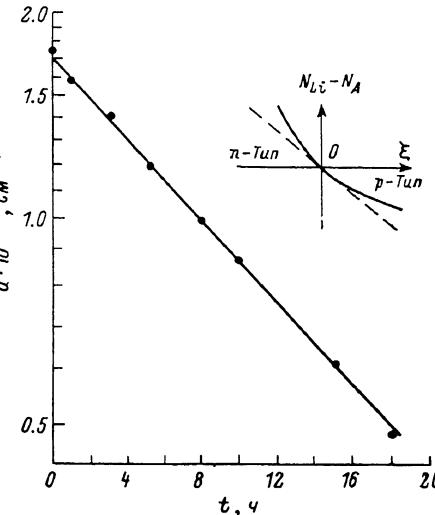
вание градиента во времени. Приведены результаты экспериментальной проверки указанной закономерности и ее практические следствия.

1. Согласно [1], динамика изменения концентрации  $N_{\text{Li}}(t)$  в дрейфующем слое лития не зависит от его поступательного движения в поле и имеет вид

$$N_{\text{Li}}(t) = \frac{N_A}{1 + [N_A/N_{\text{Li}}(0) - 1] \exp(-t/\tau)}, \quad (1)$$

где  $N_A$  — концентрация акцепторов в исходном материале;  $N_{\text{Li}}(0)$  — концентрация лития в произвольный начальный момент времени;  $\tau = \varepsilon \varepsilon_0 / e \mu N_A$ ;  $\varepsilon, \varepsilon_0$  — диэлектрические проницаемости материала и вакуума;  $e$  — заряд электрона;  $\mu$  — подвижность ионов. Выражение (1) не содержит зависимостей от координаты, так как относится к случаю, когда «наблюдатель» движется вместе с рассматриваемым слоем.

Получим выражение изменения для градиента лития в области  $p-n$ -конверсии. Для этого поместим начало отсчета  $\xi = 0$  выбранной оси координат на дрейфующую границу  $p-n$ -перехода (см. вставку на рисунке) и выберем такую область  $\xi$ , чтобы можно было считать распределение лития линейным:  $N_A - N_{\text{Li}}(\xi, 0) = a(0)\xi$ . Тогда при  $a(0)\xi/N_{\text{Li}}(\xi, 0) \ll 1$  имеем из (1)



Временная зависимость градиента концентрации лития в области дрейфующего  $p-n$ -перехода. На вставке показан выбор начала движущейся вместе с  $p-n$ -переходом оси координат  $\xi$ .

$$N_{\text{Li}}(\xi, t) = N_A \left[ 1 - \frac{a\xi}{N_{\text{Li}}(\xi, 0)} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]. \quad (2)$$

С точностью до членов, линейных по  $\xi$ , из (2) получаем  $N_A - N_{\text{Li}}(\xi, t) = a(t)\xi$ , где

$$a(t) = a(0) \exp(-t/\tau). \quad (3)$$

Окончательная формула описывает динамику изменения градиента концентрации в плоскости  $p-n$ -перехода.

2. Для экспериментальной проверки выражения (3) проводился дрейф лития из созданного диффузийного слоя — источника в кремнии с  $N_A = 2.8 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$  при  $89^\circ\text{C}$  и напряжении смещения 200 В. Площадь поперечного сечения образца составляла  $S = 1.11 \text{ см}^2$ . В процессе дрейфа были сняты вольтфарадные характеристики формирующегося  $p-n$ -перехода. Измерения емкости  $C$  проводились на частоте 1 кГц с помощью моста емкостей Е8-2. Образец предварительно охлаждался до комнатной температуры. Градиент концентрации определялся из емкостных измерений по зависимости  $1/C^3$  от напряжения  $V$  по формуле [2]

$$a = \frac{12}{e(\varepsilon \varepsilon_0)^2 S^3} \left( \frac{d(1/C^3)}{dV} \right)^{-1}. \quad (4)$$

Наклон  $d(1/C^3)/dV$  и его погрешность вычислялись по методу наименьших квадратов [3] в диапазоне напряжений, соответствующих линейному участку зависимости.

На рисунке приведен ход  $a(t)$  в полулогарифмическом масштабе. Видно, что  $a(t)$  спадает экспоненциально. Характерная постоянная времени  $\tau = (14.2 \pm 0.2)$  ч. Заметим, что эксперимент подтверждает выводы теории [1] не только качественно, но и количественно. Действительно, определенное через  $\tau$  значение

ние подвижности  $\text{Li}^+ \mu = \epsilon \epsilon_0 / e \tau N_A = 0.46 \cdot 10^{-10}$  см<sup>2</sup>/В·с хорошо согласуется с литературными данными.

Авторы глубоко благодарны Н. П. Афанасьевой за помощь в работе.

### Л и т е р а т у р а

- [1] Андреев В. М., Еремин В. К., Строкан Н. Б. — ФТП, 1987, т. 21, в. 9, с. 1673—1680.
- [2] Зи С. Физика полупроводниковых приборов, т. 1. М., 1984. 455 с.
- [3] Сквайрс Дж. Практическая физика. М., 1971. 246 с.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Получено 12.02.1988  
Принято к печати 29.03.1988

ФТП, том 22, вып. 8, 1988

## ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ

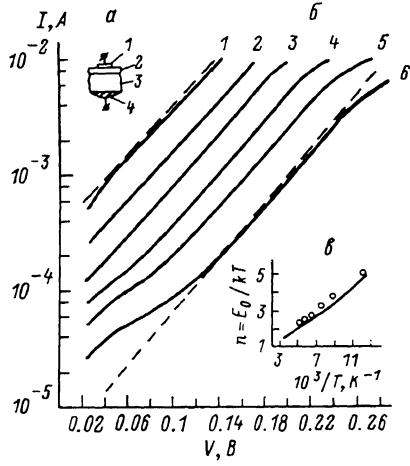
$\text{Au} - p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$

Андрушкин А. И., Салихов Х. М., Слободчиков С. В.

Многокомпонентные твердые растворы  $\text{InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$  и диодные структуры на их основе перспективны для создания фотоэлектрических и электролюминесцентных приборов в средней ИК области спектра [1, 2].

В настоящей работе сообщается о создании и исследовании электрических свойств поверхностно-барьерных структур на твердом растворе  $p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ .

Слои твердых растворов  $p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$  выращивались методом жидкотвердой эпитаксии на подложках из арсенида индия  $p$ -типа ( $p_0 = 1 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>), ориентированных в направлении (111)А. Состав эпитаксиального слоя на гетерогранице был согласован с подложкой ( $x = 0.05$ ,  $y = 0.11$ ) и плавно изменялся в направлении роста так, что ширина запрещенной зоны  $E_g$  уменьшалась к поверхности



Технологическая схема диодной структуры  $\text{Au} - p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$  (a), ВАХ (б) и температурные зависимости коэффициента неидеальности  $n$  (в).

а) 1 — Au, 2 —  $p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ , 3 —  $p\text{-InAs}$ , 4 — In + +3 % Zn; б)  $T$ , К: 1 — 195, 2 — 175, 3 — 155, 4 — 135, 5 — 117, 6 — 80; штриховые кривые — расчет по (2).

с градиентом  $\sim 2$  мэВ/мкм. Толщина выращенных слоев составляла 10—40 мкм.

Исследуемые диоды создавались напылением в вакууме золота на поверхность пленок твердого раствора  $p\text{-InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ . Технологическая схема диодной структуры дана на рисунке, а.

Измеренные  $C$ — $V$ -характеристики при 80 К показали, что зависимость емкости от напряжения смещения следует закону  $C^{-2} = f(V)$ , что свидетельствует о резком распределении электрически активных примесных центров в ОПЗ. Напряжение отсечки равно 0.29 В и соответствует значению, полученному из ВАХ. При нулевом смещении ширина ОПЗ  $W = (\epsilon \epsilon_0 S/C) = 2 \cdot 10^{-6}$  см ( $\epsilon = 14$ ). Концентрация ионизированной примеси  $N_a$  определена из выражения  $C = S [\epsilon \epsilon_0 e N_a / 2 (V + V_k)^{1/2}]$  и лежит в пределах  $(1 \div 3) \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup>.

В общем случае по виду ВАХ (см. рисунок, б) исследованных диодов в температурном интервале 80—195 К можно предположить наличие вклада двух